

マスクアライナー

(MA - 20)

ミカサ株式会社製

設置場所： バイオナノテクノロジーセンター(片柳研究所棟 6階)



半導体製造のホトリソ工程においてシリコンウエーハ、ガラスなどの基板に対して、高精度に製作されたマスクガラスのパターンをマイクロレベルの精度で位置合わせとパターン焼付けを行う装置です。

装置の特長

- マルチミラーランプハウス採用による均一性の高い照度分布
- 各種自動機構部により操作性が向上
- デジタルマイクロメーター表示によるZ軸制御（ソフトコンタクト可）
- 二視野顕微鏡採用による、スピーディーで正確なアライメント
- 試料はφ4インチ・厚みは最大2mm、マスクは5インチ角まで対応
- 水銀灯500W光源
- 装置寸法：7000W×800D×650H(mm) 重量180kg
- 専用架台：1000W×800D×650H(mm) 重量110kg